



Torino, 24 luglio 2019

## CHIARIMENTO N. 2

**OGGETTO:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)  
**CIG 796950211A - CID 321-15 – CUP E15D18000350007 – CUI F00518460019201900102**

### **Quesito 1:**

Con riferimento al Capitolato Speciali d'Oneri, avremmo un quesito da porre su un elemento tecnico di valutazione.

Ci riferiamo precisamente al punto EV7, controllo di temperatura in remoto.

Vorremmo avere maggiori dettagli circa la possibilità richiesta di monitorare ed impostare la temperatura del piatto, in remoto.

### **Risposta 1:**

Si richiede la possibilità di regolare la temperatura di processo mediante il software della macchina, in particolare in concomitanza con l'esecuzione automatica di ricette di processo.

Ufficio Appalti